

2026年度 利用可能機器と利用料金(学外利用)

利用料金は、年間登録料＋装置利用料(1時間当たりの利用料金×予約時間)となります。

年間登録料

年間登録料	60,000円/年
-------	-----------

共通機器センター Shared Research Facilities

					1時間当たりの利用料金(円)	
番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name	大学・公的機関	民間企業等
1	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ Technoplaza	X線回折装置 XRD X-ray Diffractometer	Ultima IV (Rigaku)	5,000	10,000
2				SmartLab (Rigaku)	5,000	10,000
3			走査型電子顕微鏡 SEM Scanning Electron Microscope	汎用SEM 6010LV (JEOL)	1,000	2,000
4				分析SEM with EDS (JEOL/JSM-IT510LA)	1,000	2,000
5		テクノプラザ5	電界放出型走査電子顕微鏡 FE-SEM Field Emission-type SEM	FE-SEM JSM-7610(JEOL)	5,000	10,000
6				FE-SEM JSM-7100(JEOL)	5,000	10,000
7			熱重量示差熱分析装置 TG-DTA Thermal Analysis	TG-DTA2020SA (BRUKER AXS)	1,000	2,000
8			レーザー顕微鏡 Laser Microscope	OLS4000 (Olympus)	1,000	2,000
9				OLS5100 (Olympus)	1,000	2,000
10			デジタルマイクロスコープ Digital Microscope	VH-Z100UR (KEYENCE)	1,000	2,000
11			プローブ顕微鏡 Probe Microscope	汎用AFM AFM5000 II (HITACHI)	2,500	5,000
12			光学顕微鏡 & 実体顕微鏡 Optical Microscope	BX51(Olympus) & S7-TP520-EA10-56 (SWIFT)	1,000	2,000
13			引張圧縮試験機 Mechanical Testing Machine	AG-50kNX (Shimazu)	1,000	2,000
14			ゼータ電位・ナノ粒子径測定システム Zeta-Potential and Nano-Particle-size Analyzer	DelsaMax PRO(BECKMAN COUTER)	2,500	5,000
15			フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR Fourier Infrared Spectrometer	IRAffinity-1S (Shimazu)	1,000	2,000
16			顕微フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR Fourier Infrared Spectrometer	FT-IR-4X + IRT-5200 (Jasco)	2,500	5,000
17			紫外可視分光光度計 UV-Vis Spectrophotometer	V630-BIO (Jasco)	1,000	2,000
18			テラヘルツ分光光度計 Terahertz Spectrophotometer	VIR-F (Jasco)	2,500	5,000
19			紫外可視赤外分光光度計 UV-Vis-NIR Spectrophotometer	UV-3600 Plus (Shimazu)	2,500	5,000
20			サーマルマネキン Thermal mannequin	TM8-22R (PT-Teknik)	1,000	2,000
21			テクノ工房 Techno Studio		1,000	2,000
22			低速切断機アイソメット Low speed cutting machine	Isomet (Buehler)	1,000	2,000
23			恒温振とう培養器 Homeothermic shaking incubator	BR-11FP (タイテック)	1,000	2,000
24			小型電気炉 Small electric furnace	HPM-1N (As one)	1,000	2,000
25			小型熱プレス機 Small heat press machine	AH-2003 (As one)	1,000	2,000
26	分析解析セン ター3 12F30		分光蛍光光度計 Spectrofluoro-Photometer	FP-6300 (Jasco)	1,000	2,000
27			自動接触角測定装置 Contact angle measuring device	OCA15EC (Dataphysics Instruments GmbH)	1,000	2,000
28			窒素吸着比表面積細孔分布測定装置 Adsorption Measurement	Belsorp II mini (MicrotracBEL Corp.)	1,000	2,000
29			半導体パラメータアナライザ	4156B (Hewlett packard)	1,000	2,000
30			09I25 Maskless Lithography System	DL-1000GS/SS (NanoSystem、9Fクリーンルーム)	1,000	2,000
31		13G27-b	大気圧イオン化高分解能飛行時間型質量分析計 Mass Spectrometer	JMS-T100LP (JEOL)	5,000	10,000
32		テクノプラザ5	真空加熱蒸着装置 Vacuum Evaporation System	SVC-700T (SANYU ELECTRON)	1,000	2,000
33		テクノプラザ2	顕微ラマン分光装置 Laser Raman spectrometry	LabRAM HR Evolution(HORIBA)	5,000	10,000
34			スピンコーター Spin Coater	ACT-300A II (株式会社アクティブ)	1,000	2,000
35			手動回転研磨機 Rotary Polishing Machine	LaboPol-30 (Struers)	1,000	2,000
36	テクノプラザ4		レーザー加工機 大型(A1サイズまで) Laser cutting machine	Speedy400 (Trotec Laser) 100W	2,500	5,000
37			レーザー加工機 小型(A3サイズまで) Laser cutting machine	Rayjet 50 (Trotec Laser)	1,000	2,000
38			樹脂用簡易CNC切削機	MODELA model MDX-40 (ローランド ディー・ジー)	1,000	2,000
39			熱溶解積層型3Dプリンタ Fused Deposition Modeling 3D Printer	Ender-3 V3 SE (Creality) Ender-3 S1 Plus (Creality)	1,000	2,000
40						
41		101-2	走査型電子顕微鏡 SEM Scanning Electron Microscope	新分析SEM with EDS (JEOL/JSM-IT510LA)	1,000	2,000
42			透過型電子顕微鏡TEM TEM (Transmission Electron Microscope)	JEM-2100 (JEOL)	5,000	10,000
43			集束イオンビーム加工装置 FIB (Focused Ion Beam)	MI-4050 (日立ハイテクノロジー)	7,500	15,000
44			X線回折装置 XRD (X-ray Diffractometer)	SmartLab (Rigaku)	11,250	22,500

44	大宮校舎 Omiya campus	202	単結晶X線構造解析装置 Single-Crystal Xray Diffraction	D8 QUEST(ブルカー・ジャパン)	10,000	20,000
45			窒素水蒸気吸着比表面積測定装置 Adsorption Measurement	Belsorp MaxII (MicrotracBEL Corp.)	5,000	10,000
46			真空蒸着装置 Vacuum Evaporation System	JEE-400(JEOL)	1,000	2,000
47		101-1	スピナー Spin coater	ACT-300A II (アクティブ)	1,000	2,000
48			104	プロトンビームライター PBW(Proton Beam Writer)	MBS-1000(神戸製鋼所)	5,000
49		107	核磁気共鳴装置 NMR(Nuclear Magnetic Resonance)	JNM-ECZL400R (JEOL)	15,000	30,000

ものづくりセンター Manufacturing Center

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name	大学・公的機関	民間企業等
50	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ3	バンドソー、コンターマシン Contour machine	NCC-300LE (ニコテック)	1,000	2,000
51			ファインカッター高速切断機 High-speed cutting machine	HS45A型Cタイプ (平和テクニカ)	1,000	2,000
52			CNCワイヤー放電加工機 CNC wire electric discharge machine	VL400Q (ソディック)	1,250	2,500
53			卓上フライス盤 Bench type milling machine	YS300MT (東和精機)	1,000	2,000
54			卓上旋盤 Bench lathe	YS550V (東和精機)	1,000	2,000
55			油圧プレス (5t) Hydraulic press	HYP-505H (JAM)	1,000	2,000
56			ビッカース硬さ試験機 Hardness testing machine	アカシ (ミツトヨ)	1,000	2,000
57			オートグラフ Universal testing machine	AG-20kNG (島津製作所)	1,000	2,000
58			ベンチグラインダー Bench grinder	FG255T (YODOGAWA)	1,000	2,000
59			バンドソー Band Saw	K-100 (ホーザン)	1,000	2,000
60			ボール盤 Drilling machine	TB131 (マキタ) DP3050R (REXON)	1,000	2,000
61	大宮校舎 Omiya campus	4号館4102室	マシニングセンタ	V33i (MAKINO)	5,000	10,000
62			フライス盤	AM103 (DMGMORI)	1,000	2,000
63			フライス盤	NK-1R (IWASHITA)	1,000	2,000
64			旋盤	MATE-570S (ヤマザキマザック)	1,000	2,000
65			帯鋸盤	CRA-300 (AMADA)	1,000	2,000
66			コンタマシン	U-500 (LUXO)	1,000	2,000
67			ボール盤	ESD-460 (遠州工業)	1,000	2,000
68		4号館4101室	卓上旋盤	L5200型S (コスモキカイ)	1,000	2,000
69			卓上フライス盤	FK-500S (コスモキカイ)	1,000	2,000
70			卓上ボール盤	大西機械設計	1,000	2,000
71			バンドソー	BS23 (東洋アソシエイツ)	1,000	2,000
72			ベルトグラインダー	BGM-50 (日立工機)	1,000	2,000